04

Критерий обращения электрического поля в отрицательном свечении короткого тлеющего разряда

© А.А. Кудрявцев, Н.Е. Тоинова

C.-Петербургский государственный университет E-mail: akud@ak2138.spb.edu

Поступило в Редакцию 23 декабря 2004 г.

Выполнен анализ и предложены простые аналитические формулы для оценки положения точки обращения поля в коротком (без положительного столба) тлеющем разряде по затабулированным в литературе данным для коэффициентов ионизации быстрых электронов в поле.

Возможность обращения знака аксиального электрического поля в отрицательном свечении (NG) тлеющего разряда постоянного тока давно обсуждалась в литературе [1,2]. К настоящему времени наличие этого любопытного физического явления доказано экспериментально [3] и неоднократно получено при моделировании (см., например, [4,5]). Положение x_m точки обращения поля определяет долю ионов, возвращающихся на катод. Поскольку число этих ионов часто больше, чем родившихся в катодном слое [6,7], то знание x_m необходимо для корректной формулировки условия самоподдержания разряда.

В [6] была развита самосогласованная аналитическая модель, учитывающая нелокальную ионизацию. Было указано, что в первую очередь ситуация зависит от соотношения между длинами пробега быстрых электронов Λ_f и межэлектродного промежутка *L*. Однако в [6] не были приведены конкретные выражения для x_m . Более того, в уравнение для определения x_m (см. формулу (42) в [6]) вкралась ошибка, так что его нельзя рекомендовать для расчетов.

26

В [7], на основе выражения для самосогласованного поля из [1], была получена аналитическая зависимость для x_m в виде

$$x_{mb} = d + \lambda \Big/ \ln \left(\frac{\lambda}{(L-d)} \left(1 - \exp\left(-\frac{(L-d)}{\lambda} \right) \right) \right), \tag{1}$$

где d — толщина слоя катодного падения, L — межэлектродное расстояние, λ — масштаб спада источника нелокальной ионизации в отрицательном свечении ($x \ge d$), для которого в [7] была выбрана аппроксимация

$$Z_b(x) = s_m \exp(-(x-d)/\lambda) = s_m a(x), \quad x \ge d.$$
(2)

Расчеты x_m по (1), выполненные в работе [8], показали отличное совпадение с результатами используемой в [8] модели для исследуемого там тлеющего разряда в аргоне. При этом значения характерной длины ионизации λ определялись по спаду профиля скорости возбуждения в отрицательном свечении, т.е. результатом полного моделирования разряда, включающего описание быстрых электронов методом Монте-Карло. Поскольку предварительно в каждом конкретном случае требуется проведение трудоемких вычислений, эта процедура, к сожалению, не дает возможности непосредственно предсказать значение x_m для других разрядных условий. В принципе, из Монте-Карло симуляций можно получить аппроксимационные формулы для определения λ в любых интересующих газах и их смесях. Наиболее последовательно этот подход развит в [9], где для условий аномального разряда $pd < (pd)_n$ представлены значения λ для четырех газов: аргона, гелия, азота и силана. Что касается других условий и газов, то пока в литературе нет данных для оценки длины λ.

В данной работе выполнен анализ и предложены простые аналитические формулы для оценки положения точки обращения поля по хорошо известным данным [1,2] о зависимости таунсендовских коэффициентов ионизации от поля.

Физическая причина обращения поля связана с нелокальностью ионизации в области плазмы с малым полем, которую производят быстрые электроны, родившиеся в катодном слое (см., например, [1–7]). Сильная (экспоненциальная) зависимость таунсендовского коэффи-

циента α от E/p

$$\alpha/p = A \exp(-Bp/E) \tag{3}$$

(A, B — константы, которые затабулированы для большинства газов [1,2]) приводит к неустойчивости катодного слоя и формированию катодного пятна, плотность тока в котором (нормальная) соответствует "выключению" зависимости α от E/p [10]. В таких полях скорость ионизации в данной точке определяется не полем здесь, а разностью потенциалов, которую прошли электроны, попавшие сюда с места старта, т.е. является нелокальной. Обычно для описания используют расчеты по методу Монте-Карло или прямое решение кинетического уравнения. К сожалению, отсутствие надежных данных о полном наборе необходимых сечений элементарных процессов (особенно их угловых зависимостей) делает точность расчетов во многом иллюзорной.

В данной работе при описании быстрых электронов с энергией $w \gg \varepsilon_i$ будем использовать понятие силы торможения F(w), так что характеристики ионизации определяются не локальным значением (E/p), а энергиями электронов, т. е. их EDF. Согласно многочисленным расчетам, F(w) слабо меняется с энергией при $w \leq 1000$ eV, и мы будем считать ее постоянной (подробнее см. [6,10]). Эти условия соответствуют точке перегиба ("насыщению") зависимости (3) α от E/p, которые достигаются в поле $(E/p)_m = B$. Это же условие примерно соответствует условию убегания электронов [6,10]. Электрон с начальной энергией, соответствующей катодному падению потенциала U_c , проходит путь

$$\Lambda_f = eU_c/E_m = eU_c/(pB),\tag{4}$$

пока его ионизационная способность не будет "использована полностью". Эта длина для нормального разряда соответствует значению напряжения в точке минимума кривой Пашена [1,10]. Отметим, что длина Λ_f определяет длину $\Lambda_f - d$ плазменной области отрицательного свечения [1,6]. Поскольку в тлеющем разряде длина $\Lambda_f > d$ — толщины катодного слоя, то значительная часть ионизации происходит нелокально в плазме. При $x = \Lambda_f$ (4) останавливаются самые энергичные электроны, эмитированные катодом, и справа от этой точки начинается фарадеево темное пространство (рис. 1). Электроны, которые образуются в плазме отрицательного свечения, где поле мало, не способны к дальнейшей ионизации. Поэтому ионизация здесь определяется только быстрыми электронами, пришедшими из катодного слоя, и падает с



Рис. 1. Профили источника ионизации Z(x) (кривая *I*), концентрации плазмы n(x) (кривая 2), поля E(x) (кривая 3) в коротком тлеющем разряде.

расстоянием. Этот источник ионизации Z(x) можно аппроксимировать в виде (2), а для грубой оценки длины λ можно использовать

$$\lambda \approx \Lambda_f / 2 = U_c / 2pB, \tag{5}$$

которая соответствует спаду интенсивности источника (2) примерно в $e^2 \approx 10$ раз.

Величина и направление самосогласованного поля в плазме определяются условием квазинейтральности. На катоде доминирует ионный ток, трансформация которого в электронный ток, являющийся главным вдали от катода, обусловлена ионизацией. Так как нелокальная ионизация в плазме составляет значительную долю от полной ионизации во всей прикатодной области [7,8], то ионный ток, который поступает из плазмы в катодный слой и далее на катод, порядка полного тока разряда. В отличие от катодного слоя, где поле сильное, этот ионный ток транспортируется в плазме отрицательного свечения относительно слабым механизмом амбиполярной диффузии. Поэтому градиент концентрации к катоду в плазме отрицательного свечения должен быть велик. Чтобы

транспортировать большой ионный ток (составляющий значительную долю от полного), в глубине плазмы при $x = x_m > d$ должен иметь место большой максимум концентрации n_m , на порядки превышающий концентрации как в слое, так и в положительном столбе разряда. Если ее спад к аноду не слишком пологий, то в точке x_m формируется обращенное поле (направленное к аноду), задерживающее электронную диффузию (рис. 1). Возникает потенциальная яма для электронов, а движение ионов соответствует амбиполярной диффузии [1,6]. При этом точка максимальной концентрации соответствует, с точностью до незначительного (порядка отношения подвижностей ионов и электронов $b_i/b_e \ll 1$) сдвига по отношению к аноду, точке обращения поля [7]. По сути, это условие и использовалось в [6,7] для нахождения x_m . Близость между точкой обращения поля и положением максимума концентрации наблюдалась в эксперименте [3] и в расчетах [4,5].

Таким образом, задача нахождения обращения поля в отрицательном свечении сводится к нахождению точки максимума концентрации плазмы. Для ее определения будем исходить из уравнения амбиполярной диффузии. Как и в [6,7], будем рассматривать простейший случай короткого разряда (т.е. разряда без положительного столба) между плоскопараллельными электродами. В этом случае для простой однокомпонентной плазмы с независимыми от поля и плотности подвижностями имеем

$$\frac{d}{dx}D_a\frac{dn}{dx} + Z(x) = 0,$$
(6)

где $D_a = D_i(1 + T_e/T)$ — коэффициент амбиполярной диффузии, а Z(x) — источник ионизации. Нелокальность ионизации, т.е. присутствие быстрых (способных к ионизации) электронов не только в слое, но и в плазме, приводит к ненулевому источнику Z(x) в (6) (рис. 1). Поскольку большинство электронов в плазме отрицательного свечения являются запертыми, то электрическое поле их не греет и в первом приближении коэффициент амбиполярной диффузии можно считать постоянным. Так как концентрация ионов в слоях относительно мала, на (6) можно наложить нулевые граничные условия на границе катодного слоя и на аноде: n(d) = n(L) = 0. При этом распределение n(x) по (6) имеет максимум, так что ионы, образовавшиеся при $x > x_m$, движутся к аноду; образовавшиеся при $x < x_m$ — возвращаются на

катод (рис. 1). Положение этого максимума можно найти, зная профиль источника ионизации Z(x).

При подстановке в (6) Z(x) в виде (2) для профиля концентрации получим соотношение (19) из [7]), а положение точки x_m будет выражаться формулой (1), т.е. совпадать с приведенным в [7].

Чтобы предельно упростить задачу, выберем профиль источника в (6) постоянным $Z(x) \approx Z_0 = \text{const}$ до $x \leq \Lambda_f$ и нулем при $\Lambda_f < x < L$ [6]. Тогда из (6) получим для x_m простую формулу

$$x_{mc} = \begin{cases} (2L\Lambda_f - \Lambda_f^2 - d^2)/(2(L-d)), & \Lambda_f \leq L\\ (L+d)/2, & \Lambda_f \geq L \end{cases}.$$
 (7)

Таким образом, при заданных d, L, U_c по (1) и (5) (или (7) и (4)) легко оценить положение x_m для всех газов, для которых имеются затабулированные в литературе значения B (например, в [1,2]).

В силу интегральной зависимости решение уравнения диффузии, как известно, слабо зависит от формы источника. Поэтому следует ожидать слабую зависимость x_m от профиля Z(x) в (6), т.е. результаты расчетов по (1) и (7) также не должны сильно различаться. Для проверки этого и оценки возникающих погрешностей будем использовать простейшую связь (5) между λ и Λ_f . Кривая I на рис. 2 представляет собой зависимость отношения $(x_{mb} - d)/(L - d)$ от параметра $\Lambda = \lambda/(L - d)$, соответствующую рис. 1 в [7]. Из (7) в предположении $d/L \ll 1$ получим зависимость

$$(x_{mc} - d)/(L - d) \approx \begin{cases} 2\Lambda(1 - \Lambda), & \Lambda \leq 1/2\\ 1/2, & \Lambda \geq 1/2 \end{cases},$$
(8)

представленную кривой 2 на рис. 2.

При $\Lambda \ge 1/2$ кривая 2 соответствует асимптотике для разрядов, пробой и развитие которых происходит по левой ветви кривой Пашена $(\Lambda_f > L)$. Из (6) для этого случая имеем параболический профиль концентрации плазмы

$$n_m = Z_0 (L - d)^2 / 8D_a \tag{9}$$

с максимумом концентрации (9) примерно посредине разрядного объема $x_m = (L+d)/2$.



Рис. 2. Положение точки обращения поля по формулам (1) (кривая *I*) и (9), (10) (кривая *2*).

Согласно (9), половина ионов, родившихся в плазме, при этом возвращается обратно на катод, а остальные уходят на анод. То же асимптотическое значение для x_m следует и из (1) при $\lambda \gg L$.

С ростом $L \gg \Lambda_f$ точка x_{mc} из (7) приближается к границе $x_{mc} \approx \Lambda_f$ между отрицательным свечением и фарадеевым темным пространством и все большая часть ионов возвращается из плазмы на катод. Соответственно из (1) при $\lambda \ll L$ следует асимптотика $x_{mb} \approx d + \lambda / \ln((L-d)/\lambda)$, которая дает несколько меньшее, чем (7), значение x_m .

Как видно из рис. 2, формулы (1) и (7) в достаточно широком диапазоне условий неплохо соответствуют друг другу. Далее сравним оценки по (1), (5) и (7), (4) с данными [4,5] для аргона с $B = 180 \text{ V/(cm} \cdot \text{Torr})$ из [1].

Симуляции по многопучковой (multibeam) модели, представленные на рис. 10 из [4] для условий (p = 0.6 Torr, L = 2 cm, d = 0.22 cm,

U_c , V	d, cm	x_m , cm	Λ_f , cm	x_{mb} , cm	x_{mc}, cm
125.8 124 123.9 138.9	0.59 0.44 0.4 0.34	0.86 0.63 0.6 0.34	0.7 0.69 0.69 0.77	0.75 0.66 0.63 0.53	0.68 0.63 0.62 0.58

Результаты сопоставлений с данными [5].

 $U_c = 300 \text{ V}$), дают расчетное значение $x_m = 1.02 \text{ сm}$. Для этих условий из (4) $\Lambda_f \approx 2.8 \text{ сm} > L$, так что как $x_{mb} = 1.05 \text{ cm}$, так и $x_{mc} = 1.1 \text{ cm}$ хорошо соответствуют полученным в [4].

Сравнение с результатами оценок для данных табл. 1 из [5] (p = 1 Torr, L = 1 cm), представленное в таблице, указывает на хорошее соответствие оценок как x_{mb} , так и x_{mc} .

Для применения оценок по простым формулам (1), (7) необходимо, чтобы поперечный размер был $R \gg \Lambda_f - d$, а давление не было слишком большим, т.е. чтобы характерная длина объемной рекомбинации $l_r = \sqrt{D_a \tau_r}$ превышала продольный размер $l_r \gg \Lambda_f - d$ ($\tau_r = 1/(\beta n_e)$), где β — коэффициент рекомбинации. В этом случае длины разряда недостаточно для образования положительного столба, а геометрию можно считать одномерной.

Таким образом, можно рекомендовать следующую процедуру приближенного нахождения точки обращения поля в коротком тлеющем разряде ($R, l_r \gg L$). По значению катодного падения U_c и табличным данным для константы B аппроксимации (3) для α от E/p оценивается длина пробега быстрых электронов (4) $\Lambda_f = eU_c/(pB)$. Далее по формуле (7) или (1), (5) оценивается длина x_m .

Для рассматриваемых здесь коротких разрядов необходимо принимать во внимание следующие важные обстоятельства [6,10]. Электронный ток можно разделить на диффузионную и дрейфовую компоненты лишь в случае, когда характерный масштаб потенциальной ямы для электронов L-d превышает длину энергетической релаксации электронов λ_{ε} [6]. Если же длина L-d окажеся меньше, чем λ_{ε} , то разделение тока на диффузию и дрейф теряет смысл и необходим кинетический анализ. В атомарных газах $\lambda_{\varepsilon} \approx \lambda/\sqrt{2m/M} > 100\lambda$, так что условие $L-d > \lambda_{\varepsilon}$ выполняется лишь при pL > 10 сm. К сожалению,

в большинстве исследуемых коротких тлеющих разрядов условия не удовлетворяют этому неравенству.

Авторы выражают глубокую благодарность Л.Д. Цендину за стимулирующие обсуждения.

Работа выполнена при поддержке гранта CRDF RP-1-567-ST-03. А.А. Кудрявцев также благодарит за поддержку грант ISTC № 3098.

Список литературы

- [1] *Райзер Ю.П.* Физика газового разряда. М.: Наука, 1992. (Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н. // ТВТ. 1991. Т. 29. № 6. С. 1041–1053).
- [2] Энгель. Ионизованные газы. М.: Физматгиз, 1959. 332 с.
- [3] Gottscho A., Mitchell A., Scheller G.R., Chan Yin-Yee, Graves D. // Phys. Rev. A. 1989. V. 40. N 11. P. 6407–6414.
- [4] Surendra M., Graves D.B., Jellum G.M. // Phys. Rev. A. 1990. V. 41. N 2. P. 1112–1125.
- [5] Fiala A., Pichford L.C., Boeuf J.P. // Phys. Rev. E. 1984. V. 49. N 6. P. 5607– 5622.
- [6] Kolobov V.I., Tsendin L.D. // Phys. Rev. A. 1992. V. 46. P. 7837-7850.
- [7] Boeuf J.P., Pichford L.C. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1995. V. 28. P. 2083–2088.
- [8] Maric D., Kutasi K., Malovic G., Donko Z., Petrovic Z.Lj. / Eur. Phys. J. 2002.
 V. 21. P. 73–81.
- [9] Peres I., Ouadoudi N., Boeuf J.P., Pichford L.C. // J. Appl. Phys. 1992. V. 72. P. 4533–4537.
- [10] Кудрявцев А.А., Цендин Л.Д. Тлеющий разряд постоянного тока. Энциклопедия низкотемпературной плазмы / Под ред. акад. В.Е. Фортова. М.: Наука, 2000. Кн. II. С. 18–28.